

1. レーザーの基礎

1. Fundamentals of Lasers

上 原 日 和 UEHARA Hiyori 自然科学研究機構 核融合科学研究所 (原稿受付: 2021年 2 月 4 日)

1960年にメイマンがレーザー発振を実証して以来,レーザーはあらゆる分野に応用され,プラズマ・核融合 分野はもちろん,現代の情報通信,自動車生産,先進医療などを支えている.本講座では,レーザーの構成原理 と技術要素について全3回にわたって解説する.第1回となる本章では,1.1 レーザーの歴史,1.2 レーザーの 動作原理,1.3 レーザーの分類と特徴,について解説する.

Keywords:

solid-state lasers, gas lasers, laser diodes

1.1 レーザーの歴史

1.1.1 レーザーとは

レーザー (laser) は、Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation の頭文字を集めた頭字語であり、 「輻射の誘導放出による光増幅」を意味する. **図1**は光の吸 収と放出を説明した概念図である.励起状態 E_2 にある原子 は、一定の励起寿命が経過すると、とある確率で自発的に 光子を放出して準位 E_1 に緩和する(自然放出).しか し、準位 E_2 にある原子に、2準位間のエネルギー差 $h\nu$ に等しい光を入射すると、原子はそれに誘導されて、入射 光と波長・位相・方向・偏光の揃った光子を放出して即座 に準位 E_1 に緩和する.これが誘導放出であり、この現象を



National Institute for Fusion Science, Toki, GIFU 509-5292, Japan

利用して増幅した光やその発生装置のことをレーザーと呼 ぶ[1]. 誘導放出の特性からわかるように,レーザーは波 長と位相が時間的・空間的に揃った特殊な光(コヒーレン ト光)である.レーザーの特徴として,一つの色から成る 単色性,ビームが一定方向に直進する指向性,レーザー同 士が互いに干渉し合う可干渉性が挙げられる.ビームを狭 い領域に絞ってエネルギー密度を高めることができるのも レーザーの特徴である.これら特徴を活用することで,自 然光では成し得なかった計測や,物質と光の強い相互作用 を人為的に引き起こすことが可能になる.

1.1.2 レーザー開発の歴史

レーザー動作の基礎となる誘導放出の理論は,1916年に Einstein によって発表された.様々な理論検証の後,1954 年にTownsらは,アンモニアガスを用いて誘導放出による 増幅作用を最初に観測した.このときの波長は1.25 cmの マイクロ波であり,メーザー (MASER)と呼ばれている.

世界で最初のレーザーは、1960年に Maiman がルビー結 晶をフラッシュランプで励起することでパルス発振動作を 実証した.同じく1960年に Javan らは、He-Ne レーザーの 連続発振に成功し、その後、1960年代にArイオンレーザー や CO₂ レーザーなどのより高出力なガスレーザーが、1970

author's e-mail: uehara.hiyori@nifs.ac.jp

年代に紫外域のエキシマレーザーが開発された. 固体レー ザー開発においては, ルビーレーザーに続いて, Nd ガラス レーザー, Nd:YAG レーザーが1960年代に開発された. 波 長 1.06 µm で発振する Nd:YAG レーザーについては後ほど 詳細に解説するが、高出力な連続波、パルス動作が可能で あることから、現在最も代表的な固体レーザーとなってい る. 1961年に初の発振実証がなされたファイバーレーザー も固体レーザーの一種であり、現代社会において重要な役 割を担っている[2]. 1965年の Kao の光ファイバー通信の 提案を皮切りに、1970年代には通信用光ファイバーの高品 質化が為され、1987年には Er 添加ファイバー増幅器が開 発,その後実用化された.通信用途以外でも,NdやYb 添加の高出力ファイバーレーザーの開発が進み、キロワッ ト級ファイバーレーザーは、今や YAG レーザーや CO₂ レーザーと並ぶ主要な加工用光源にまで発展した[3].こ こまで,代表的なレーザーについてのみ述べたが,固体 レーザー,ガスレーザー,色素レーザー,半導体レーザー, 自由電子レーザーなど,数えきれない種類のレーザー媒質 での発振器がこれまでに開発され、発振波長は遠赤外線か ら X 線に及んでいる. これまでに報告されているレーザー や市販レーザーの波長については文献[4]に詳しい.

従来の固体レーザーは、ガラスや結晶を利得媒質とする ものが主であった.しかし、ガラスのように成形性が高く、 大口径化が可能で、なおかつ単結晶のような優れた熱特 性・光特性を兼ね備えた透明セラミックス材料が近年注目 を集めている.1995年にIkesue がレーザー発振可能な YAG セラミックスを実証してから[5]、レーザー媒質用透 明セラミックスの開発、および次世代の高出力セラミック レーザーの研究が盛り上がりを見せている[6].レーザー 材料については、次号掲載予定の本講座第2章「固体レー ザー材料」において、レーザーセラミックス開発に携わる 北見工業大学・古瀬裕章氏より解説する.

一方,固体レーザーの短パルス化の歴史に着目する と, 1961年に, ルビーレーザーを用いた Q スイッチ発振が 考案され、パルス幅は1us以下に短縮した.このQスイッ チング技術の登場によって、パルスエネルギーとピーク出 力が飛躍的に向上し、ラマンレーザーの発振や高調波発生 など、非線形光学の広範な研究が展開されるようになっ た. その後,モード同期レーザーが実証されてからは、パ ルス幅はサブピコ秒まで短縮された. さらに、フェムト秒 オーダーの超短パルスレーザーが広く用いられるようにな り, 光パラメトリック発振や高調波発生, 和周波・差周波 発生などの非線形光学効果を利用した波長変換が容易に なった.特に、1982年に登場した Ti:sapphire レーザーは、 その広い利得帯域のために 10 fs 以下の超短パルス化が可 能である. 1985年に Mourou らが考案したチャープパルス 増幅[7]とパルス圧縮技術の進歩によって,現在では、ミリ ジュール級のフェムト秒 Ti:sapphire レーザーが市販され るようになった. 最近では、このような超短パルスレー ザーによる高次高調波発生過程を用いたアト秒パルスの発 生が実現し、計測応用のための光源高性能化が進められて いる[8]. さらに、モード同期レーザーの実証に伴って周 波数コムという概念が誕生しており,これを利用した次世 代計測法の開発が活発になっている[9].

レーザーを語るうえで、半導体レーザーの存在を忘れて はならない. 1957年に Nishizawa が半導体レーザーの最初 提案をしたのち, 1962年に GE, IBM, MIT の 3 研究所でほ ぼ同時に,低温でGaAsのpn接合を用いて近赤外レーザー のパルス発振が観測された.その後,1970年に室温連続発 振が実証され、1979年に面発光レーザーが、1994年に量子 カスケードレーザーが誕生しており、半導体レーザーの発 振波長は現在,紫外から中赤外域までをほぼ連続的に網羅 している[4]. 半導体レーザーは,比較的安価で,発振波長 や出力のバリエーションが豊富なため、ブルーレイなどの 光学ドライブ,光ファイバー通信,レーザープリンターな ど身近な装置に多数実装されている. YAG レーザーや ファイバーレーザーなど固体レーザーの励起光源として も, 高出力な半導体レーザー (LD:Laser diode) が重要な役 割を担っている.LDの高効率・高出力化,長寿命化が進ん だことから、フラッシュランプ励起に代わって LD 励起の Nd:YAG レーザーが普及しつつある. LD の出力も年々飛 躍的に向上しており、アレイ化やスタック化でキロワット を超えるものが上市されるようになった[10].

以上,簡単に纏めたが,レーザーの発明や開発の歴史に ついては,文献[11-14]により詳しく記載されている.特に 文献[11]は,開発年表を関連文献と併せて参照することが できるため,レーザーの歴史に興味のある方にはそちらを ご覧いただきたい.

プラズマ・核融合科学に関連した最近の動向としては, 大型の固体レーザー施設が全世界で建設されており、高出 力化が急速に進んでいる.パルスエネルギーが高いもので は,米国ローレンス・リバモア国立研究所の NIF やフラン ス原子力委員会の LMJ に代表されるナノ秒のメガジュー ル級レーザーが運用されている.また、ピーク出力が高い ものでは,大阪大学の LFEX やフランスの PETAL などの ピコ秒ペタワット級レーザーのほか, 量子科学技術研究開 発機構の J-KAREN などのフェムト秒ペタワット級レー ザーが開発されている。これらのレーザーは、レーザー核 融合、レーザー粒子加速、プラズマフォトニクス、超高圧 物性や実験室宇宙物理等の高エネルギー密度科学分野のほ か、レーザー加工などの産業用途も含めた幅広い応用が期 待されている.近年の世界におけるパワーレーザー開発の 実情や高エネルギー密度科学の動向,今後の展望について は、文献[15]に詳細が記載されている.また、パワーレー ザーの高繰り返し化に取り組む大阪大学・北島将太朗氏が 著者となり、本講座第3章において、高出力固体レーザー 技術の概要と最新動向について解説予定である.

このように現代のレーザーは、遠赤外線から X 線までの 発振波長、単一光子からペタワットまでの出力、アト秒か ら連続波までのパルス幅を網羅し、その多様性は計り知れ ない.レーザー技術の著しい進展に伴い、小型で高効率か つ信頼性の高いレーザー光源が産業・医療・科学などの分 野で実用に供されるようになった.レーザー光源への要求 は益々高度化・多様化しており、高出力化、短パルス化、 高効率化,低価格化,新波長帯開発など,様々なニーズに 応じた研究開発が今後も展開されていくであろう.

1.2 レーザーの動作原理

1.2.1 反転分布の形成

ここでは、レーザーの動作原理について、なるべく簡単 に説明する. レーザーがいかにして発振するかを理解する には、まず、反転分布について知っておく必要がある.い ま、図1に示したようなエネルギー状態E₁, E₂を有する系 を考え、準位 E₁ をレーザー下準位、E₂ をレーザー上準位 と呼ぶこととする. ここにエネルギー hv の光を入射する と、(a)吸収と(c)誘導放出のどちらもが誘導されるが、吸 収によって光子数が減少し、誘導放出によって光子数は増 加(増幅)する、つまり、レーザーの効果である光増幅を 得るには、誘導放出が吸収を上回らなければならず、下準 位状態にある原子(分子)数N1よりも上準位状態にある原 子数 N_2 のほうが多い必要がある. このように $N_2 > N_1$ と なっている状態のことを反転分布状態と呼び、この状態を 形成することがレーザー動作の基本となる. 通常の熱平衡 状態においては、ボルツマン分布に従って $N_2 < N_1$ となっ ているため、反転分布を形成するには、第3、第4の準位 を介して光励起(主に固体レーザー)を行うか、放電励起 (主にガスレーザー),電流注入(半導体レーザー)による 励起が必要となる[1].

1.2.2 レーザー発振器の概要

図2にレーザー発振器の概念図を示した. レーザーの主 な構成要素は、①誘導放出を起こすためのレーザー媒質, ②レーザー媒質を反転分布状態にするための励起源, ③光 を閉じ込めて増幅するための光共振器,である.図の光共 振器は、対面したミラー対で構成されたファブリ・ペロー 共振器であり,一方のミラーの反射率は十分に高く,もう 一方のミラーは光の一部が透過する部分反射ミラーとなっ ている.励起源からのエネルギーを吸収して反転分布状態 となったレーザー媒質は、等方的に蛍光を発するが、その うちの共振器ミラー間を往復して生き残る光のみが誘導放 出によって増幅される.特に,図中に波線で電場分布を示 したような共振条件を満たす光は、共振器内に効率的に閉 じ込められるため、レーザー媒質を往復(増幅)する回数 が多くなり、共振器内の光強度が高くなる. 共振器で増幅 された光の一部は、部分的に光を透過する出力ミラーから 共振器外に取り出され,これがレーザー出力として取り扱 われる.このような働きから、出力ミラーは、出力結合鏡 (アウトプットカップラー)とも呼ばれている.

共振条件を満たす光の波長は、その整数倍が共振器内の 光路長(距離と屈折率の積)と等しく、一定の周波数間隔 でレーザーが発振しており、このような発振モードの分布 を縦モードという.これに対し、ビーム断面方向のモード 分布のことを横モードと呼んでいる.ファブリ・ペロー型 のレーザー共振器で生じる基本横モード(TEM₀₀ モー ド)はガウスビームで、ビーム品質を示すパラメータであ る M²(エムスクエア)=1である.これに対し、高次の横 モードが含まれた場合、レーザービームの強度分布はガウ ス分布とは大きく異なり[16], M²の値は大きくなる. レーザービームの M² が1 に近ければ,レンズを用いて回 折限界に近いスポット径を得ることが可能であるが,M² が大きくなるに従って集光特性が悪化する.そのため, レーザー加工などの高エネルギー密度を必要とする用途に おいて M² は重要なパラメータである.図2では,平面ミ ラー2枚を用いた最も単純な共振器構成を例に挙げたが, 共振器長に応じて,損失が小さくより安定性の高い球面凹 面鏡等がしばしば用いられる[17].また,ファブリ・ペ ロー共振器を用いたレーザー以外に,光を一方向に周回さ せて閉じ込めるリング共振器レーザー[2]や,共振器構造 を持たないランダムレーザー[18],ウィスパリング・ギャ ラリーモードを利用した微小共振器レーザー[19] なども存 在する.

1.2.3 レーザーの発振条件

前述のように、共振条件にある光は反転分布媒質を往復 するたびに誘導放出によって増幅されるが、弱い励起状態 では共振器の損失が増幅による利得を上回り、光は減衰し てしまう.励起を強くするにしたがって利得が大きくな り、損失を上回ったときにレーザーが発振する(発振しき い値).利得係数g、利得媒質の長さをl、利得媒質の誘導 放出断面積 σ_{en} を用いると、 $gl = \sigma_{en}(N_2 - N_1)$ で表さ れ、媒質を一往復した際の利得は、 $G = \exp(2gl)$ となる. **図**2に示したように、共振器損失が反射率 R_1, R_2 のミラー によるもののみと仮定した場合、レーザーの発振条件は、 $R_1R_2 \exp(2gl) = 1$ となる.発振しきい値を超えると、レー ザー出力は励起パワーに比例して増加し、励起に対する レーザー出力の増加率をスロープ効率という.レーザー出 力を制限する要因や、レーザーの高効率化に求められる材 料パラメータの解説は、次章以降に譲る.

1.2.4 Q スイッチング

レーザー動作には,一定の出力を連続して発振する連続 波(CW)発振動作と,パルス状の出力を一定の時間間隔で 発振するパルス発振動作がある.一般的なパルスレーザー では,主に,Qスイッチング,モード同期,ゲインスイッ チング,キャビティダンピングなどの手法でパルス化され ており,ここでは特に馴染みの深いQスイッチング,並び にモード同期法について解説する.図3は,それぞれ同じ 平均出力を有する連続波レーザーとパルスレーザーの出力 の時間変化を示した概念図である.上述の手法でパルス化 すると,短い時間にエネルギーを集中させることができる





図3 連続波動作とパルス動作の出力の時間変化(双方で同じ平 均出力を有する場合).

ため、連続波動作と比較してピーク出力が圧倒的に高くな る.1つのパルスが持つエネルギー(出力の時間積分)の ことをパルスエネルギーと呼び、パルスエネルギー(単 位:J)=平均出力(単位:W)/繰り返し周波数(単位: Hz)で計算できる.また、ピーク出力(単位:W)=パルス エネルギー/パルス幅(単位:s)である.

Q スイッチングとは、レーザー共振器の光閉じ込め効率 (Q 値)を変調してレーザー出力を短パルス化する手法で ある(図4).まず、レーザーが発振しないように共振器の 損失を大きくした状態で媒質を励起することでエネルギー を反転分布として蓄積する.次に、共振器の損失を急激に 小さくすると、誘導放出が促進し蓄積エネルギーが一気に 短時間でレーザー出力として放出される. この手法によっ て、例えば、ナノ秒のパルス幅とミリジュール級のパルス エネルギーを安定的に得ることが可能になる. 共振器損失 を高速で変調するためのQ スイッチ素子には、音響光学変 調器や電気光学変調器、回転鏡などが用いられ、これらス イッチを能動的に駆動してQ スイッチ発振動作を得るこ とを能動のスイッチングと呼ぶ、それに対し、入射光強度 が高くなると受動的に透明化する性質を持つ可飽和吸収体 を, 共振器中に入れてQ スイッチパルスを生成すること を, 受動Q スイッチングという. Q スイッチレーザーで は、共振器長に比例してパルス幅が短くなるため、レー ザー結晶と可飽和吸収体、共振器ミラーを一体化したコン パクトな受動Q スイッチ・マイクロチップレーザーが開 発されており、1 ns を下回る短パルス化が達成されている [20].

1.2.5 モード同期

Q スイッチレーザーよりも更に短いピコ秒,フェムト秒の時間幅のパルスを生成する手法として,モード同期法がある.1.2.2項でレーザーの縦モードについて説明したが,通常のレーザーでは,複数の縦モードがばらばらの位相関係で発振している.図5に示すように,共振器内の全ての縦モード同士の位相を揃えると(図の点線位置で位相が同







図5 モード同期の概念図.

期),モードの合成によってパルスが生成され,これを モード同期という.モード同期状態では共振器中で1つの 光パルスが存在しており,これが共振器を往復する度に部 分反射ミラーから出力される.共振器内の光の周回時間に 合わせて共振器損失や利得を変調し,全ての縦モードを同 時に発振させることでモード同期が達成される.例えば, 光路長が1.5 m(往復3m)のファブリ・ペロー共振器の場 合,モード同期パルスの繰り返し周波数は約100 MHzとな り,これに合わせて音響光学変調器などで能動的に変調す る手法を強制モード同期という.それに対して,光強度が 高くなると受動的に共振器損失が小さくなる可飽和吸収機 構を設けることで,周回時間に合わせて変調する手法を受 動モード同期という.

モード同期法における可飽和吸収機構には,共振器の周 回時間よりも速い回復が求められ,半導体可飽和吸収ミ ラー(SESAM)などの可飽和吸収体やカーレンズ効果,非 線形偏波回転などの非線形光学効果が用いられる.生成さ れたパルスのピーク付近のみで透過率が高くなるため,可 飽和吸収体を通過するたびにパルス幅は短縮する.しか し,共振器中に分散媒質(波長で屈折率が大きく変わる物 質)が有る場合,群速度分散によってパルス幅が伸びてし まい,位相同期も達成されない.そのため,負の分散特性 を持つ材料を挿入したり,チャープミラーやプリズム等で 分散を補償するのが一般的である.

モード同期パルスは、多数の縦モードを合成したものと 述べたが、レーザー光に含まれる縦モードの数が多いほ ど、合成したパルスの時間幅は短くなる.また、光のスペ クトル幅とパルス幅の間には不確定性の関係が成立し、ス ペクトル幅が広いほど理論的に生成可能な最短パルス幅 (フーリエ限界パルス幅)は短くなる.例えば、中心波長 800 nm、スペクトル幅 200 nm の Ti:sapphire レーザーを仮 定した場合、フーリエ限界パルス幅は約5 fs となる.一方、 中心波長 1064 nm、スペクトル幅 0.5 nm の Nd:YAG レー ザーでは、フーリエ限界パルス幅は約3 ps となるため、 フェムト秒パルスを得ることは不可能である.

1.3 レーザーの分類と特徴

1.3.1 レーザーの分類

代表的なレーザーの種類とその発振波長を図6に纏めた.現代のレーザーは、遠赤外線からX線までの発振波長、 単一光子からペタワットまでの出力、アト秒から連続波ま でのパルス幅を網羅しており、多様性に富んでいる.以下、



固体レーザーを中心に、ガスレーザー、半導体レーザーに 大きく分類し, それぞれのカテゴリーにおいて特に代表的 なレーザーについて、発振器構成を例示しつつ特徴を解説 する.

1.3.2 固体レーザー

固体レーザーは、利得媒質に固体材料を用いた主に光励 起のレーザーであり,透明な結晶やガラス母材に,発光中 心となる希土類金属もしくは遷移金属イオンをドープした ものが一般的である.近赤外波長のものが最もメジャー で、波長1µm 近傍で発振する Nd:YAG, Yb:YAG, Yb:ガ ラスファイバーレーザーや、波長 800 nm の Ti:sapphire レーザーがよく知られており、小型で大出力を得ることが できる

・Nd:YAG レーザー

イットリウム・アルミニウム・ガーネット $(Y_3Al_5O_{12})$ に ネオジム(Nd³⁺)を添加した Nd:YAG 結晶を媒質とした レーザーで,励起波長は808 nm,発振波長は1064 nm であ る. 高出力固体レーザーとして最も普及しているレーザー で, CW 動作で kW 級出力のものや, ナノ秒 Q スイッチ動 作でジュール級のパルスエネルギーのものが製品化されて いる. 非線形光学結晶を使った第2高調波:波長532 nm, 第3高調波:355 nm, 第4高調波:266 nm の発生も可能 であり、レーザー分光計測、プラズマ発生などの学術用途 のほか、レーザー加工などの産業用途にも幅広く用いられ ている.Nd:YAGの第2高調波レーザーは、後述する Ti: sapphire レーザーの励起光源としても知られている.

Nd:YAG レーザーの励起光源は、これまでは、安価で高 出力なキセノンフラッシュランプがメジャーであったが, 寿命が短く、スペクトルが広帯域なため吸収効率が低いと いう欠点を持つ. そのため, 近年では, より長寿命かつ吸 収波長で選択的に励起可能な LD が励起光源に選ばれつつ ある. 図7は、単純な構成のLD励起、及びフラッシュラン プ励起 Nd:YAG レーザーの概念図である. 主に、レーザー ビームと同軸方向に励起する端面励起方式と、ロッドの側 面から励起光を入射する側面励起方式に分けられる.

高出力QスイッチNd:YAGパルスレーザーの構成の一例 を図8に示す.励起光源のフラッシュランプ,及びYAG







図8 Q スイッチ Nd:YAG レーザーの構成の一例.

ロッドは、熱負荷を軽減するために循環水で冷却される. 高反射ミラー/出力ミラー間がレーザー共振器(発振器) となっている. 電気光学効果を利用したポッケルスセルと 1/4 波長板,ポラライザーを組み合わせることで高速な Q スイッチとして機能する.スイッチング原理を理解するた め、ポッケルスセルが ON のとき、OFF のときの光の伝搬 と偏光方向を図の下部に載せた.発振器のQ スイッチパル スは、第二のNd:YAG ロッドで増幅される。その後、温度 制御された非線形光学結晶で第2,第3高調波を発生して 出力する. 非線形結晶には, KTP, KDP, DKDP, LBO 結晶などがよく用いられる.

著者の所属する核融合科学研究所においても, Nd:YAG レーザーが随所に用いられている.図9は、同研究所の安 原亮氏がウィスコンシン大学と共同開発した、プラズマ計



核融合科学研究所・安原氏の開発した高繰り返しで高出力 図 9 な Nd:YAG レーザーの外観.

測用の高繰り返しNd:YAGレーザーの外観である.20 kHz もの繰り返し周波数で、1 Jを超えるパルスエネルギーでの 出力を実現した.大型ヘリカル装置(LHD)におけるトム ソン散乱計測は、従来 30 Hz の繰り返し周波数で行われて いたが、このレーザーを導入することで、50 μs の時間分解 でのプラズマ温度、密度計測が新たに可能になった[21].

・Ti:sapphire レーザー

熱伝導に優れたサファイア(Al₂O₃)結晶にチタン(Ti³⁺) をドープしたTi:sapphire結晶は,広い吸収・発光スペクト ルを有する.波長514 nmのアルゴンイオン(Ar⁺)レーザー や532 nmのNd:YAGレーザー等で励起し,中心波長は 800 nmのものが一般的だが,波長 660~1180 nm に亘って 連続的に発振が可能である.利得帯域が極めて広いため, 超短パルス化に適しており(1.2.5項参照),フェムト秒時 間分解分光,非線形光学,白色光発生,テラヘルツ波発生 などの研究に用いられる.また,高いピーク出力に達する ことから,プラズマ発生やアブレーション加工にも実用化 されている.固体レーザー特有の耐久性を有しながら,波 長可変性にも優れており,近年は色素レーザーに代わる存 在となっている.また,最近,光励起半導体レーザー (OPSL)を励起源としたTi:sapphire発振器も登場している.

図10は、カーレンズモード同期 Ti:sapphire レーザー発振 器の一例である.モード同期の原理は1.2.5項で述べた通 りである.ここでは、可飽和吸収機構として非線形光学効 果のひとつであるカーレンズ効果を採用している. 凹面鏡 対を用いた Z 型(もしくは X 型)配置にすることで,結晶 におけるモード径を小さくすることができる. これによ り、非線形性の高い Ti:sapphire 媒質内でカー効果が発現 し、光強度が高いタイミングで屈折率が増加して光が収束 する.このカーレンズ効果発現時のみ光が透過するよう に、共振器中にスリットを配置することで、モード同期が 達成される.カー効果が誘起されると、局所的な屈折率増 加(位相速度低下)に伴ってパルス後方に位相が引き寄せ られる (チャープする) 自己位相変調が生じる. ここに, 前 述した群速度分散の影響が加わると、パルス幅が著しく伸 びるため、プリズム対による補償を試みている. 屈折率が 低い(速度が速い)ほど,第二のプリズム内をより長く通 過するように配置することで、短いパルスを保つことがで きる. Ti:sapphire 結晶は、反射損失を無くすため、ブ リュースター角にカットされており、ブリュースター入射 で生じた収差はZ型配置による収差で相殺できる.

モード同期 Ti:sapphire レーザー発振器で生成した繰り 返し数10~100 MHzのフェムト秒パルスは,図11のような 再生増幅器で増幅し,kHzオーダーの繰り返し周波数で使







図11 再生増幅 Ti:sapphire レーザーの構成.

用されるのが一般的である.再生増幅器とは,増幅媒質を 配置した共振器内で種光パルスを多数回往復させて,十分 なエネルギーまで増幅したのち,共振器外に取り出す手法 である.図中のミラー1と2が共振器のエンドミラーで, 図8のQスイッチ機構と同様にして,ポッケルスセル, 1/4波長板,ポラライザーの組み合わせが高速スイッチと して機能する.励起光源には,QスイッチNd:YAGレー ザーなどが一般的に用いられる.この再生増幅器の前にパ ルス幅をns程度まで引き延ばすストレッチャーを設け,長 いパルス幅(低いピーク強度)のまま mJまで増幅した後, 再びパルス幅をフェムト秒に圧縮することで,媒質の破壊 限界を超えた増幅が可能になる(チャープパルス増幅法[7]). ・ファイバーレーザー

ー般的に「ファイバーレーザー」というと、イッテルビ ウム (Yb³⁺) 添加石英ガラス光ファイバーを媒質とした高 出力レーザーのことを指す.励起波長は900~980 nm で、波長 1030~1100 nm において発振可能である.励起用 LD の高出力化に伴って、ファイバーレーザーの出力も飛 躍的に向上しており、連続波 10 kW を超えるものが製品化 されている.ファイバーレーザーはビーム品質に優れるた め、YAGレーザーやCO₂レーザーに代わる主要な産業加工 用光源になりつつある.

Yb ファイバーレーザー発振器の基本構成を図12に示し た.数100 W 出力の LD 複数台からの励起光を励起コンバ イナー(もしくは WDM カップラー)で結合し,高出力励 起する.Yb 添加した利得ファイバーの両端には,ファイ バー・ブラッグ・グレーティング(FBG)と呼ばれるレー ザー波長1070 nm のみを反射するミラーがファイバー内に 加工されており,これが共振器ミラーの役割を果たす. ファイバーレーザーは,小型・軽量化が容易で,バルク結 晶と比較して比表面積が大きく放熱性に優れるため,熱負 荷が低く,キロワット級の連続波出力をメンテナンスフ リーで得ることができる.一方で,コア断面積の制限によ り光強度が比較的高くなるため,非線形光学効果が発現し



図12 Yb ファイバーレーザーの基本構成.

やすく,高パルスエネルギー動作には不向きである.しかし,非線形効果を利用したモード同期が容易であることから,ErやYbを活性元素としたnJ程度のパルスエネルギーのフェムト秒ファイバーレーザーが数多く研究されている.

今日の光ファイバー通信では、1.5 µm 波長帯の光信号が 使われるが、伝送損失を補償するための増幅機構にエルビ ウムファイバー増幅器(EDFA)が利用されている.これ も図12の構成を基本としており、共振器 FBG を持たず、 LD励起したEr添加ファイバーの一端から1.5 µm信号光を 結合し、増幅した信号をもう一端から取り出すものである.

・中赤外固体レーザー

波長2µmを超える中赤外レーザーの開拓,高出力化が 激化している.2µm帯では、ツリウム(Tm³⁺)やホルミ ウム(Ho³⁺)を発光中心とした固体レーザーやファイバー レーザーが普及し始めており、kWに迫るものも報告され ている[22].3µm帯では、波長2940 nmのEr:YAGレー ザーが医療分野に導入されているほか、30W連続波出力 のErフッ化物ファイバーレーザー[23]や10Wに迫るEr 系固体レーザー[24]が著者らによって開発された.波長 3~5µmは、分子の赤外吸収線が多数存在する「指紋領域」 に当たり、大気中での減衰も小さいため、センシング用光 源の発展が予想される波長領域である.

クロム (Cr²⁺) や鉄 (Fe²⁺) などの遷移金属を添加した カルコゲン化物固体レーザーは、中赤外域に広帯域な利得 を有し、高出力化や短パルス化の研究が盛んである. Cr:ZnS/ZnSe レーザーは波長 2~3 μ m, Fe:ZnS/ZnSe レー ザーは波長 4~5 μ m で高出力発振可能で[25]、レーザー 加工、リモートセンシング、高次高調波発生などの用途に 有望である.

・可視光固体レーザー

近赤外波長が話題の中心であった固体レーザーだが、よ り長波長側の中赤外域への開拓が進むと同様に、より短波 長側の可視域で直接発振する固体レーザーの研究も近年盛 んになっている. プラセオジム(Pr³⁺), テルビウム (Tb³⁺), ジスプロシウム(Dv³⁺)などの希土類を活性元素 に用いたフッ化物結晶は、青~赤に亘る可視域で発振可能 である.特に,青色 LD 励起の Pr:YLF レーザーは,青(波 長約 490 nm), 緑 (520 nm), 橙 (600 nm), 赤 (640 nm, 720 nm) に代表される複数波長において高効率で発振する [26]. 従来, 可視光固体レーザーは, 主に YAG レーザーの 高調波発生によって得られていたが、直接発振レーザーで は非線形波長変換を必要としないため、より高効率かつ高 出力な可視レーザーの候補である.また、1段の波長変換 (SHG)のみで紫外線レーザーが得られるため[27], YAG の第3,第4高調波レーザーに代わる光源となるだろう. また、非常に小型かつロバストなシステムで狭線幅な紫外 レーザー出力が得られるため、色素レーザーに代わる励起 光源として、レーザー誘起蛍光 (LIF) 法などプラズマ診断 への適用が将来期待される[28].

1.3.3 ガスレーザー

ガスレーザーは,利得媒質にガス分子(原子)を用いた 主に放電励起のレーザーである.分子の密度が低いため, 大出力は得にくいが, 放電手法やガス圧などを最適化する ことで高出力化も可能である.励起状態のガス分子は無輻 射緩和が遅いため,ガスレーザーのスペクトル線幅は一般 的な固体レーザーよりもはるかに狭くなり,可干渉性に優 れているのが特徴である.固体レーザーでは発振の難しい 紫外~可視や,赤外波長域のレーザーが揃っている.

・He-Ne レーザー

出力こそ10 mW未満と低いが,様々な場面において馴染 みの深いレーザーである.HeとNeの混合ガスを媒質とし ており,放電励起されたHe原子がNe原子と衝突すること で,励起状態となったNe原子が発光中心となる.最もメ ジャーな発振波長は632.8 nmで,波長安定性が高く,コ ヒーレンスに優れているため,干渉計測,レーザー測長, レーザー顕微鏡,ホログラフィー再生光源など幅広い用途 で用いられている.小型・軽量でビーム拡がりが小さく, 視認性にも優れるため,固体レーザー開発におけるアライ メント用マーカーとして重宝される.

・Ar⁺レーザー

放電によってイオン化したアルゴンを媒質としており, 10 W を超える高出力発振が可能である.代表的な発振波 長は,514.5 nm と 488.0 nm で,干渉計測のほか,ラマン分 光用途や Ti:sapphire レーザーの励起光源として用いられ る.大電力と冷却機構を要するため,比較的大型で高価で ある.同じく希ガスレーザーであるクリプトン(Kr⁺)レー ザーも同様の原理で発振し,赤色の高出力コヒーレント光 を得ることができる.

・エキシマレーザー

励起状態の原子と基底状態の原子が結合した励起二量体 (excimer)を媒質とするレーザーで,高圧の希ガスとハロ ゲンの混合気体を放電励起することで発振する.代表的な ものでは,ArF,KrCl,KrF,XeCl,XeFレーザーが挙げ られ,図6に示すように,波長150 nm~350 nmの深紫外領 域においてサブジュール級の高出力パルスを発振する. フォトリソグラフィーを用いた半導体微細加工プロセスに おける露光光源として用いられており,社会的重要性の高 いレーザーといえる.その他,パルスレーザー堆積法の光 源や,レーシック手術にも利用される.

・炭酸ガスレーザー

炭酸ガス (CO₂) 分子が発光中心であり,炭酸ガスにヘ リウム,窒素を混合して封入したガス管を放電励起し,遠 赤外領域で発振する.主要な発振波長は10.6 μm であるが, 9.6 μm の発振線もよく知られている.連続波及びパルス動 作で高出力発振が可能で,ガス圧や流量,媒質長さの最適 化で,kW 級もの出力に達する.可視・近赤外レーザーと 比較して材料吸収の大きな波長であるため,加工優位性が 高い.そのため,様々な材料を対象とした加工用光源とし て産業応用されている.

著者の所属する核融合科学研究所では、炭酸ガスレー ザーを光源に用いたレーザー干渉法によるプラズマ密度計 測が為されている。同じく、同研究所で干渉計測用光源と して採用されている遠赤外アルコールレーザー(詳細は後 述)においても、炭酸ガスレーザーが励起源に用いられる.

・遠赤外線レーザー

ここで,核融合科学研究所において電子分布密度計測 用レーザー干渉計に用いられている遠赤外メタノール (CH₃OH) レーザーについて紹介する[29].装置の概略を 図13に示した. この遠赤外レーザーの発振波長は119 µm で、周波数は 2.5 THz であり、テラヘルツレーザーともい える. 干渉計利用のために双子型のレーザー構成となって おり[28], それぞれの出力は約100mW である. CH₃OH レーザーは、光での励起が一般的で、励起光源には出力約 100 Wの連続波 CO₂ レーザーを使っている. この CO₂ レー ザーは, 共振器の光軸方向に放電を起こす縦放電方式を採 用しており,安定的な連続波発振動作が可能である.更に 大きな出力が要る場合は、より高いガス圧で、光軸に垂直 方向に放電する横放電方式が取られることが多い. なお, CO2管, CH3OH管のいずれも循環水による冷却がなされて いる. CO2 レーザー共振器の回折格子ミラーを調整するこ とで、CH₃OHの吸収が大きい9P(36)発振線にチューニン グする. さらに, 出力ミラーをピエゾステージ (図中①) で 光軸方向に移動させ、共振器長を制御することで、CO2 レーザーの縦モード周波数(発振波長)をCH₃OH吸収線と 一致させる. CH₃OH レーザー共振器の入力ミラーには, 励 起光結合のための空孔が開いているが、戻り光防止のため にミラー中心からわずかに位置が外れている.出力ミラー には、シリコン基板上にドーナツ状の金がコーティングさ れたものを用いており、ミラー中心部で出力結合してい る. 双子型のいずれの出力ミラーも自動ステージ (図中②, ③)に接続されており、独立した共振器長調整が可能であ る.まず、プローブレーザーの出力をフィードバックし、 プローブ共振器長を制御して、レーザー出力を安定化す る. それと同時に、プローブ/ローカル光のヘテロダイン 信号を取得し、ビート周波数のフィードバックによって ローカル側共振器長を制御し,周波数を安定化している.

1.3.4 半導体レーザー

半導体レーザー(LD)は、固体の半導体結晶を媒質としているが、励起手法やエネルギー構造が通常の固体・ガスレーザーと大きく異なるため、分けて考えられる.図14に 典型的なダブルヘテロ構造のLDの構成図を示す.p型クラッド層/活性層/n型クラッド層の組み合わせは、例えば、AlGaAs/GaAs/AlGaAsなどがある.ここに電流を流すと、n型クラッド層の伝導帯の電子が、同時にp型クラッド層の価電子帯の正孔が、それぞれ活性層の伝導帯と価電





図14 ダブルヘテロ構造半導体レーザーの概略図.

子帯へと効率的に注入される.活性層に生成された電子-正孔対が再結合することで,活性層からの発光が生じる が,これを誘導放出で増幅する点は,固体レーザーと同じ である.図14のような半導体結晶のへき開面を共振器ミ ラーとしたLDが一般的であるが,基板に対して垂直に出 力される面発光レーザーも存在する.

一般的な固体・ガスレーザーと比較して,LDは,発振ス ペクトル幅が広く,ビーム品質が悪いものが多い.しかし, 分布帰還型(DFB)の縦単一モードLDや,光励起半導体 レーザー(OPSL)などのビーム品質に優れた単一横モー ドのLDも存在しており,用途や価格に応じた光源選択が 可能である.

半導体の構成元素の組み合わせや比率を変えることで, 発振波長を自由に選択できるのも LD の特徴である.出力 を問わなければ、紫外から中赤外に亘る全域で市販の LD が揃っている.さらに,量子カスケードレーザーなどの特 殊形態のレーザーも含めると, 遠赤外領域までを連続的に 網羅できる.紫外~近赤外の低出力LDは、固体レーザーと 比較して小型かつ安価なため、ブルーレイなどの光学ドラ イブ、光ファイバー通信、レーザープリンターなど身近な 装置に多数実装されている.Nd:YAG,Yb:YAG,Ybファ イバー, Er ファイバーレーザーに代表される LD 励起固体 レーザーには、波長 810 nm, 910 nm, 980 nm, 1480 nm のLDが主に使われており、アレイ化やスタック化技術に よってキロワットを超えるものが入手できるようになっ た.このLD高出力化に伴って,固体レーザー出力も飛躍的 に向上しており、LD 技術の発展がレーザー分野全域に与 える影響は計り知れない.

参 考 文 献

- [1] W. Koechner, *Solid-State Laser Engineering* Sixth Revised and Updated Edition (Springer Sciene + Business Media, Inc., New York, 2006).
- [2]住村和彦,西浦匡則:解説ファイバーレーザー-基礎 編-(オプトロニクス社, 2011).
- [3] 西澤典彦:光学 42, 438 (2013).
- [4] M.J. Weber, *Handbook of Laser Wavelengths* (CRC Press LLC., Baca Raton, 1999)
- [5] A. Ikesue et al., J. Am. Ceram. Soc. 78, 1033 (1995).
- [6] 池末明生:レーザー研究 47,420 (2019).
- [7] G. Mourou, Opt. Commun. 56, 219 (1985).
- [8] 小栗克弥:レーザー研究 45,205 (2017).

Lecture Note

- [9] 美濃島薫:レーザー研究 46,354 (2018).
- [10] 菅 博文 他: 電気学会論文誌 C 125, 187 (2005).
- [11] レーザー学会:レーザーハンドブック第2版(オーム 社, 2005), I編.
- [12] 霜田光一: レーザー研究 29,28 (2001).
- [13] 霜田光一: レーザー研究 38, 10 (2010).
- [14] 霜田光一:光学 34,634 (2005).
- [15] 日本学術会議 提言「パワーレザー技術と高エネルギー 密度科学の量子的飛躍と産業創成」(2020).
- [16] 黒澤 博:ゼロから始めるレーザーの教科書 (オプトロ ニクス社, 2017), 第7章.
- [17] 多田邦雄 他: ヤリーヴーイェー 光エレクトロニクス 基礎編 (丸善出版, 2010), 第4章.
- [18] 岡本 卓:光学 43, 211 (2014).



うえ はら ひ より 上原日和

自然科学研究機構 核融合科学研究所 ヘリ カル研究部 高温プラズマ物理研究系 助 教. 2012年,東京工業大学大学院理工学研 究科・博士後期課程修了(博士(工

学)).2012年~北海道大学電子科学研究所,2016年~大阪大 学レーザー科学研究所を経て,2019年4月より現職.主に中 赤外波長の高出力固体レーザー,ファイバーレーザーの開発 を行っています.開発した光源を利用したレーザー加工やセ ンシングなどの応用研究や,半導体微細加工技術を駆使した 新規光学デバイス開発にも興味が有ります.共同研究大歓迎 です.

- [19] H. Uehara et al., J. Opt. Soc. Am. B 28, 2436 (2011).
- [20] T. Taira et al., IEEE J. Quantum Electron. 46, 277 (2010).
- [21] R. Yasuhara *et al., Laser Aided Plasma Diagnostics* (White-fish, September 2019).
- [22] T. Ehrenreich *et al., SPIE Photonics West* (San Francisco, January 2010).
- [23] H. Uehara et al., Opt. Lett. 44, 4777 (2019).
- [24] R. Yasuhara et al., Opt. Express 28, 19000 (2020).
- [25] H. Uehara et al., Opt. Lett. 45, 2788 (2020).
- [26] G. Huber et al., Opt. Lett. 39, 3193 (2014).
- [27] R. Yasuhara et al., Opt. Lett. 45, 5558 (2020).
- [28] プラズマ・核融合学会:プラズマ診断の基礎と応用(コ ロナ社, 2006),第5章.
- [29] 中山和也 他: プラズマ・核融合学会誌 87,801 (2011).